

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «09» февраля 2023 года

№ 02/01

В соответствии с «Регламентом о порядке отчисления обучающихся из федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» утверждаю следующие составы и графики заседаний комиссий института лазерных технологий по проведению повторной промежуточной аттестации у обучающихся, получивших задолженности в течение промежуточной аттестации осеннего семестра 2022/2023 учебного года (Приложение).

Директор ИЛТ


(личная подпись)

Г.В. Одинцова

(ФИО)

Приложение к распоряжению № 04/р от "09" февраля 2023 года

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
Комиссия №1 председатель: Сергеев М.М. секретарь: Карлагина Ю.Ю. члены комиссии: • Петренко А.А. • Синев Д.А. • Смирнова И.Г.	Заседание №1 21.03.2023, 10:00, ZOOM Заседание №2 07.04.2023, 10:00, ZOOM	Введение в лазерные технологии	L3116, L3117
		Введение в профессиональную деятельность	L32161, L32181, L32182
		Введение в специальность	L3116, L3117
		Лазерные технологии	K34402, M33001, N33461, R34381, T33301, T33302, ЛАТ 1, ЛАТ 1.1 online, ЛАТ 1.2 online, ЛАТ 1.3 online, Общий поток
		Проектная деятельность	ПД 1.2, ПРД 2.1
		Учебная, ознакомительная	L33161
Комиссия №2 председатель: Храмов В.Ю. секретарь: Пушкарева А.Е. члены комиссии: • Беликов А.В. • Смирнов С.Н. • Шамова А.А.	Заседание №1 24.03.2023, 11:00, ZOOM Заседание №2 07.04.2023, 11:00, ZOOM	Биофотоника	L34162
		Введение в лазерные технологии	B5608
		Взаимодействие излучения с веществом	L34162
		Взаимодействие лазерного излучения с веществом	L42174
		Когерентная оптика	L34162
		Лазерная фотоника	B33001, B33003, L33161, L33162, L33182
		Лазерные микро- и нанотехнологии	L42174
		Математическое моделирование физических процессов	L33161, L33162, L33181, L33182, L4117, L42174
		Научно-исследовательская	L4117

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
		работа	
		Оптика плазмы	L34162
		Оптические системы для лазерной обработки материалов	L34162
		Основы лазерной техники	L34162
		Производственная, научно-исследовательская работа	L42174
		Производственная, технологическая (проектно-технологическая)	L42174
		Тепловые режимы в лазерных и оптоэлектронных системах	L34162
		Фотоника	L4117